

EPODOC / EPO

PN - JP6036233 A 19940210

PD - 1994-02-10

PR - JP19920191035 19920717

OPD - 1992-07-17

TI - THIN-FILM MAGNETIC HEAD

AB - PURPOSE:To obtain a magnetic thin film provided with high corrosion resistance by a method wherein a wet chromate protective film whose etching amount is 200Angstrom or lower is formed on the surface part of an alloy layer composed mainly of Co and/or . CONSTITUTION:A magnetic thin film is formed by a wet plating method such as an electroplating method or the like. A chromate protective film is formed on the magnetic layer by a wet chromate treatment. The chromate protective film is formed to be a thickness of 100Angstrom or lower, the protective film is formed of a required magnetic-pole surface, and no film is formed on the rubbing face of a slider. Since the chromate layer is formed after having melted a CoFe surface slightly, a ball part is set to a recessed state and not damaged by CSS or the like.

IN - SHINOURA OSAMU; KIMURA FUJIMI

PA - TDK CORP IC - G11B5/31

© WPI / DERWENT

 Thin film magnetic head, with corrosion resistance and improved properties - comprises wet chromate protective film on the surface of the alloy

PR - JP19920191035 19920717

PN - JP6036233 A 19940210 DW199411 G11B5/31 004pp

PA - (DENK) TDK CORP

IC - G11B5/31

AB - J06036233 A new thin film magnetic head has a wet chromate protective film which is etched to thickness of 200 angstroms on the surface of an alloy layer based on Co and/or

Pref. the amt. etched is up to 100 angstroms. The chromate treatment is pref. carried out lightly using chromic acid. The magnetic thin film is pref. formed by electric electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or vapour deposition may be used. The Co and/or electroless of substitutional plating, or alternatively sputtering or a

- USE/ADVANTAGE - The head has high corrosion resistance, saturation magnetic flux density and good CSS characteristics.(Dwg.0/1)

OPD - 1992-07-17

AN - 1994-086689 [11]

ΦPAJ/JPO

PN - JP6036233 A 19940210

PD - 1994-02-10

AP

- JP19920191035 19920717

IN - SHINOURA OSAMU; others: 01

PA - TDK CORP

TI - THIN-FILM MAGNETIC HEAD

AB - PURPOSE To obtain a magne

- PURPOSE:To obtain a magnetic thin film provided with high corrosion resistance by a method wherein a wet chromate protective film whose etching amount is 200Angstrom or lower is formed on the surface part of an alloy layer composed mainly of Co and/or

- CONSTITUTION:A magnetic thin film is formed by a wet plating method such as an electroplating method or the like. A chromate protective film is formed on the magnetic layer by a wet chromate treatment. The chromate protective film is formed to be a thickness of 100Angstrom or lower, the protective film is formed of a required magnetic-pole surface, and no film is formed on the rubbing face of a slider. Since the chromate layer is formed after having melted a CoFe surface slightly, a ball part is set to a recessed state and not damaged by CSS or the like.

FAIS PAGE BLANK (USPTO)

JP6036233

- G11B5/31

THIS PAGE BLANK (USPTO)

anis PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-36233

(43)公開日 平成6年(1994)2月10日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 5/31

H 8947-5D

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

特顯平4-191035

(71)出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(22)出顧日 平成

平成4年(1992)7月17日

(72) 発明者 篠浦 治

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー

ディーケイ株式会社内

(72)発明者 木村 富士巳

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー

ディーケイ株式会社内

(54) 【発明の名称】 薄膜磁気ヘッド

(57)【要約】

【目的】 高飽和磁束密度及び高耐食性を有する薄膜磁気へッドを、量産性に優れた湿式クロメート処理により実現する。

【構成】 Coまたは、かつFeを主成分とする薄膜磁気へッドのボール部分にエッチング量が200A以下であるクロメート皮膜を形成したヘッド。耐食性が良く、CSS特性の劣化もない。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Coまたは、かつFeを主成分とする合 金層の表面部分にエッチング量が200A以下である湿 式クロメート保護膜を設けたことを特徴とする薄膜磁気 ヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、薄膜磁気ヘッドに関す

[0002]

【従来の技術】薄膜磁気ヘッドの磁性薄膜には、低保磁 力、高飽和磁束密度、低磁歪等の優れた軟磁気特性が要 求されると同時に信頼性向上の為に高耐食性が必要であ

【0003】特に近年の記録密度の上昇は記録媒体の保 磁力の上昇による部分が大きい。保磁力の大きな記録媒 体に十分に書き込む為には記録ヘッドからより強い磁界 を発生する必要がある。このために従来から広く使用さ れていたNi-Fe合金(パーマロイ)以上の高飽和磁 東密度材料が求められている。この磁気特性的な要求を 20 満たす磁性めっき膜としてはCo-Fe合金等が挙げら れる。

【0004】しかし、耐食性では従来から広く使用され ている比較的低飽和磁束密度材料であるNi-Fe合金 と比較すると劣っていた。

【0005】Co-Fe合金等の耐食性向上のためには 第3元素の添加が有効であるが、優れた軟磁気特性を損 なわないで耐食性を向上させることは困難であった。

【0006】また耐食性を向上させる為に膜厚の厚い保 **護膜を形成することは磁気ヘッドの磁極としてはスペー 30** シングロスのために好ましいことではなかった。

【0007】また加工して磁極部が露出したのちに保護 膜を形成する必要があり、スパッタ法等での成膜では目 的とする磁性層表面だけでなくスライダーの摺動部にま で保護膜が形成されてしまいCSS特性等での信頼性に 悪影響を及ぼすことが懸念され、さらに量産性等の理由 から真空成膜保護膜での解決は困難である。

【0008】クロメート処理は特に亜鉛めっき、錫めっ きにおいて良く知られている。たとえばめっき技術便覧 (日刊工業新聞社刊、昭和46年) 243ページには亜 40 鉛めっき上のクロメート膜について膜組成、メカニズ ム、作業方法について詳細に記されている。またニッケ ルめっきにおいても一般的に使用されている。

【0009】さらに特閧51-47401号、特開62 -183021号にはめっき磁気記録媒体の耐食性向上 のためのクロメート皮膜が述べられている。

【0010】しかし従来のクロメート処理は処理される 金属皮膜を1ミクロンメートル以上溶かし出し、形成さ れるクロメート皮膜も1000A以上であった。また大 面積試料全面にわたって処理が行われる量産性が重視さ 50 筆すべきは防錆膜を設ける必要のある磁極表面にのみ形

れていた。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような事 情からなされたものであり、低保磁力、高飽和磁束密度 な磁性薄膜の特性を損なうことなく十分な耐食性を有す る薄膜磁気ヘッドを製造することにある。

2

[0012]

【問題点を解決するための手段】本発明者は、上記課題 を解決するために鋭意検討、研究した結果、Coまた は、かつFeを主成分とする合金層表面に湿式クロメー ト皮膜を形成することで耐食性に優れ、磁気特性を損な わないで、かつヘッドの媒体との摩擦特性も劣化させな いヘッドを完成するに至った。

【0013】このような目的は、下記の本発明により達 成される。

【0014】(1) Coまたは、かつFeを主成分と する合金層の表面部分にエッチング量が200A以下で ある湿式クロメート保護膜を設けたことを特徴とする薄 膜磁気ヘッド。

[0015]

【作用】本発明の磁性薄膜は特に好ましくは湿式めっき 法、すなわち電気めっき法、無電解めっき法及び置換め っき法により形成される。しかしスパッタ、蒸着法等で 成膜されたものでもなんら差し支えない。

【0016】磁性層組成はCoまたは、かつFeを主成 分とすることでBs≥1.3T以上の高飽和磁束密度の 膜が形成出来る。

【0017】また、本発明の磁性合金にはRh、S、 N. B. Ni. Nb. C. Cr. Cu. Sn. Ru. A u, Pd, Ag, Mn, P, In, Mo, Pb, Re, W、Zn、Zr及びPt等から選択される1種以上の元 素を含有することで各種特性の向上等も期待される。ま たこのような元素を不純物として若干量含有することも 特に支障は認められないので安価な材料の使用によるコ スト低減も可能である。

【0018】本発明はこれらの磁性層上に湿式クロメー ト処理によりクロメート保護膜を設けてなる。

【0019】本発明に用いられるクロメート処理は薄膜 磁気ヘッドの特徴にかんがみ、極薄膜化が要求される。 このため従来から使用されているクロメート条件よりも ソフトな条件での処理が好ましく、クロム酸のみで、他 の無機酸の添加はわずかか、なくても良い。

【0020】クロメート処理は元の皮膜をエッチングす るが通常の防錆クロメートでは数ミクロンメートル以上 のエッチングが一般的である。しかし本発明のクロメー ト処理では200A以下であることが必要で特に100A 以下が好ましい。エッチング量が前記以上だとスペーシ ングロスが大きくなりヘッド出力が低下してしまう。

【0021】また特に蒋膜ヘッド磁極の保護膜として特

.3

成されスライダーの摺動面には一切成膜されないことである。さらに僅かにCoFe表面を溶解したのちクロメート層が形成されるためにポール部は凹状盤となり薄膜保護膜であるがCSS等でダメージを受けない。

【0022】さらに完成品ヘッド状態での表面処理も可能で、この場合には磁極露出部だけでなく金属が露出しているジンバルやボンディングパット部にもクロメート皮膜が形成され、これらの部分の信頼性向上にも寄与する

【0023】さらにこのクロメート層の上に他の種類の 保護層を形成することも差し支えない。たとえはフッ素 系潤滑剤(モンテジソン社製、フォンブリンAM-20 01等)やスパッタカーボン膜、プラズマダイヤモンド ライクカーボン膜等の形成が可能である。ただしスペー* *シングロスとなるために膜厚は注意せねばならない。 【0024】このように第2保護膜を形成する場合にクロメート膜は超薄膜のため下地層として有利である。 【0025】

【実施例】以下、本発明の具体的実施例を挙げる。

【0026】めっき法により成膜されたCo-4Fe軟 磁性薄膜を有する薄膜磁気ヘッド製造工程においてダイヤモンド砥粒によりポール部分が加工された直後に以下のクロメート処理を施したヘッドをサンプル1、2、3とする。またクロメート処理を施さなかったヘッドをサンプル4とした。

【0027】クロメート処理

[0028]

【表1】

		クロ	ــ بر ا	卜被組	成			処理	時間
<u> </u>	酸化) u L	ij	建硝酸		渡塩酸		(秒)
サンプル 1	0.	5 g	0.	2 ml	Ο,	2 m l		3 0	
サンプル 2	1.	0 g	0.	2 ml	Ο.	2 m l	3	0 0	
サンプル3	5.	0 g	5.	0 ml	1.	5 m1	3	0 0	

クロメート液組成は純水1リットルへの調合量

処理温度:室温

【0029】ヘッド動特性評価は、65℃95%、1000時間の耐食性試験の前後で9.5MHzでの出力を測定した。また非接触表面変位計エリオニクスにてポール部の凹量を測定した。

【0030】結果を表2に示す。また別途CSSテストを行ったが全て5万回をクリアした。

※【0031】また3インチウエハー上に成膜されたCo Fe膜にサンプル1と同様のクロメート処理を施した試 料を用いて蛍光X線分析装置でCr層厚を測定したとこ 30 ろ金属クロム換算で4.6Aであった。

[0032]

【表2】

	耐	ヘッド出力 耐食性試験前 耐食性試験後					
			クロボルト)	(A)			
ンプル1		5 1 1	5 1 0	3 0			
ンプル 2		5 2 3	5 2 0	1 0 0			
ンブル3	(比較例)	3 3 0	3 3 0	3 5 0			
ンプル4	(比較例)	5 2 0	2 1 0	1 0			

[0033]

【発明の効果】本発明によれば、高耐食性な磁性薄膜が容易に得られる。しかもCSS特性を損なわない。

【図面の簡単な説明】

【1図】 本発明の実施例を示す薄膜磁気ヘッドの断面 図を示すである。 【符号の説明】

- 1 磁性層
- 2 クロメート層
- 3 ギャップ層
- 4 コイル
- 50 5 絶縁層

6 保護層

5

[図1]

